

16. Гольдаде В. А., Пинчук Л. С. Электретные пластмассы: физика и материаловедение.— Минск: Наука и техника, 1987.
17. Лимасов А. И., Покровский С. Ф. Использование ЭОПа для исследования скользящих разрядов по поверхности твердых диэлектриков // Тр. СибНИИЭ.— 1972.— № 10.
18. Сливков И. Н. Электроизоляция и разряд в вакууме.— М.: Атомиздат, 1972.
19. Андреев С. И., Зобов Е. А., Сидоров А. Н. Исследование скользящей искры в воздухе // ПМТФ.— 1978.— № 3.
20. Зобов Е. А., Литвинова И. Г., Сидоров А. Н. Исследование скользящей искры тепловым методом // ПМТФ.— 1986.— № 1.
21. Белоедова И. П., Иванов А. В., Колечицкий Е. С., Ларионов В. П. Применение электрографии для исследования объемного заряда в длинных воздушных промежутках // Электричество.— 1980.— № 2.
22. Белоедова И. П., Иванов А. В. и др. Измерение заряда стримерных образований положительного импульсного разряда // Электричество.— 1981.— № 6.
23. Комельков В. С. Развитие электрического разряда в длинных промежутках // Изв. АН СССР. ОТН.— 1950.— № 6.
24. Базелян Э. М., Горюнов А. Ю. О механизме развития стримеров в резко однородном электрическом поле // Электричество.— 1986.— № 11.
25. Базелян Э. М. Лидер положительной длиной искры // Электричество.— 1987.— № 5.
26. Горин Б. Н., Шкилев А. В. Измерение токов молнии на Останкинской телебашне // Электричество.— 1984.— № 8.
27. Базелян Э. М. Выбор точки удара разрядом молнии // Электричество.— 1974.— № 10.

г. Ленинград

Поступила 13/III 1989 г.

УДК 533.9

Ю. С. Протасов, С. Н. Чувашев

## О СКЕЙЛИНГЕ ПЛАЗМОФОКУСНЫХ ИЗЛУЧАЮЩИХ РАЗЯДОВ МАГНИТОПЛАЗМЕННОГО КОМПРЕССОРА ЭРОЗИОННОГО ТИПА

Излучающие плазмодинамические разряды (ПДР) магнитоплазменного компрессора (МПК) эрозионного типа являются основными элементами различных перспективных практически важных плазменных систем [1—3]. Для ряда приложений необходимо существенное повышение энергомощностных характеристик таких разрядов (до  $10^{10}$ — $10^{11}$  Вт,  $10^6$ — $10^7$  Дж). Высокая трудоемкость проведения многопараметрической экспериментальной оптимизации в указанной области делает весьма актуальной предварительную теоретическую оптимизацию. Изучению рабочих процессов в указанных разрядах посвящено значительное число работ ([4—7] и др.), на это нацелена программа исследований [8—12]. Серьезным препятствием здесь была недостаточная степень изученности одного из основных рабочих процессов — эрозионного плазмообразования, из-за чего в численных моделях поток массы плазмы  $\rho_p v_p$  приходилось задавать из эксперимента или полуэмпирических зависимостей, надежных только в исследованной области энерговклада ( $P = 10^7$ — $10^9$  Вт,  $W = 10^2$ — $10^6$  Дж), для определенной геометрии и рабочих веществ. Данная работа — этап на пути к решению этих задач.

**1. Механизм плазмообразования.** МПК эрозионного типа представляет собой систему аксиально-симметричных электродов, между которыми организуется сильноточный ( $10^4$ — $10^7$  А) разряд. Плазма образуется при эрозии межэлектродной шайбы, ускоряется собственными магнитными полями в токовом слое у диэлектрика и тормозится при магнитной фокусировке на оси симметрии, образуя плазменный фокус (ПФ), где излучает часть своей внутренней энергии [7, 6, 13]. Ранее для  $P = 0,05$ —1 ГВт было установлено, что эрозия твердого диэлектрика в ПДР МПК связана с потоком излучения разряда [14], разложение диэлектрика — со сложными неравновесными химическими реакциями [15]. В самом начале разряда может быть значительна роль теплоотвода в глубь стенки, что приводит к запаздыванию начала эрозионного выхода массы относительно начала разряда [16]. На основе данных [6, 17] в [12] были получены полуэмпирические зависимости для мгновенного потока массы  $\rho_p v_p$ . Сопостав-

ление расчетов [12] с экспериментами [18] показало возможность экстраполяции этих зависимостей до 4–5 ГВт.

Анализ временных зависимостей скоростей потока плазмы в течение основной стадии разряда указывает на инерционность плазмообразования относительно энерговклада, причем сравнительно небольшое временное рассогласование  $t_* \leq 0,1t_{1/2}$  ( $t_{1/2}$  — полупериод) уже приводит к существенному разбросу массы по скоростям, резкой зависимости от времени для температуры и излучательной способности основной излучающей зоны — плазменного фокуса [8, 12].

Ионизация паров (собственно плазмообразование) происходит в узком практически локально-одномерном слое на границе плазмы с диэлектриком или его парами. Можно показать, что процессы в этом слое определяются линейной плотностью тока  $i$ , А/м (или перепадом магнитного поля  $\Delta B$ ) и потоком поглощаемого в слое излучения  $S_0$ . В МПК-разрядах, работающих на водороде, дейтерии и др., плазмообразование связано с омическим нагревом [19, 20], т. е. зависит от значения  $i$ . По аналогии в эрозионных системах также выход массы обычно связывался с силой тока [4, 8, 12]. Имелся еще ряд открытых вопросов, например, неясна была причина инерционности плазмообразования в основной стадии разряда (прогрев диэлектрика [16] на этой стадии роли не играет, а время реакции ионизации [15] существенно меньше  $i_*$ ), неизвестны закономерности формирования радиального распределения  $\rho_p v_p$  и др.

Излучательная способность в фокусе МПК, однако, на несколько порядков выше, чем в других зонах [6, 8]; преобладает вакуумный ультрафиолет (ВУФ), для него пары непрозрачны, а плазменный поток полупрозрачен [8, 21]. Поэтому естественно предположить, что в излучающих МПК-разрядах плазмообразование связано с ионизующей радиационной волной РВ, в которой пары диэлектрика поглощают световой поток  $S_0$  из плазменного фокуса, т. е. считать, что в упомянутом выше локально-одномерном слое значения  $i$  и  $S_0$  таковы, что ионизация зависит только от  $S_0$ . Тогда, отвлекаясь от весьма сложных [15, 16], но менее энергоемких по сравнению с ионизацией процессов испарения (дающего, кроме того, не непосредственно необходимый в расчетах поток плазмы  $\rho_p v_p$ , а поток паров  $\rho_v v_v \geq \rho_p v_p$ ), имеем локальный мгновенный поток массы

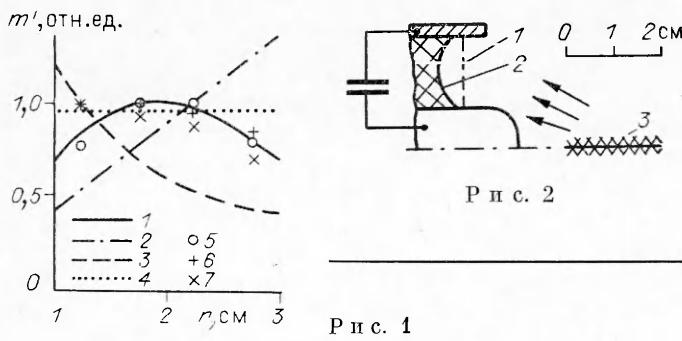
$$(1) \quad \rho_p v_p = \rho_0 v_0 = S_0 m_i h_{i0}^{-1},$$

где  $\rho$  — плотность;  $v$  — скорость;  $m_i$  — масса среднего иона;  $h_{i0}$  — изменение энталпии в РВ на один ион;  $h_{i0} \gg I_i$ ,  $I_i$  — энергия ионизации атомов; индексом 0 здесь и далее отмечены параметры ускоренного плазменного потока.

Покажем, что такой подход качественно и количественно верно отражает особенности плазмообразования в ПДР эрозионного типа и что можно рассчитывать на создание на его основе численных моделей, способных решать поставленные выше задачи.

На основе (1) получается правильная оценка массы плазмы. Действительно, проинтегрировав (1) по поверхности и по времени, находим  $M_\Sigma' = m_i W \eta_l \eta_d / (h_{i0}(1 - \eta_d))$  ( $W$  — энерговклад,  $\eta_l$  — световой КПД,  $\eta_d$  — часть излучения, попадающего на диэлектрик); с другой стороны,  $M_\Sigma' \bar{v}_0^2/2 = W \eta_k$  ( $\eta_k$  — кинетический КПД,  $\bar{v}_0$  — средняя скорость плазмы). Для данных [6, 8] ( $\eta_l = 12\%$ ,  $\eta_d = 0,3$ ,  $\eta_k = 0,8$ ,  $m_i = 16,7$  у. а. е. м.,  $I_i \approx 15$  эВ,  $\bar{v}_0 = 5 \cdot 10^4$  м/с) находим  $\bar{M}_\Sigma' = 5 \cdot 10^{-6}$  кг  $\approx \bar{M}_\Sigma'' = 6 \cdot 10^{-6}$  кг.

Представления о плазмообразовании под действием излучения из плазменного фокуса соответствуют экспериментальным профилям эрозионного выхода массы. Так, на рис. 1 показано радиальное распределение для интегрального по азимуту выноса массы  $m' = \int \rho_p v_p 2\pi r dr$  с поверхности межэлектродной диэлектрической вставки: расчет в предложении: 1 — освещения источником, расположенным в зоне торможения потока, сфокусированного под углом  $30^\circ$  (источником в ПФ); 2 — рав-



Р и с. 1

Р и с. 2

номерного светового потока из плазмы разряда; 3 — пропорциональности светового потока омическому нагреву, т. е.  $i$ ; 4 — приближение  $m' = \text{const}$ , использованное в [8]; 5, 6, 7 — эксперименты [17] при внешнем цилиндрическом электроде для энергии 1, 2, 3 кДж соответственно. Видно, что кривая 1 согласуется с [17], а 2 и 3 — нет. Кроме того, из представленного на рис. 2 профиля плазмообразующей шайбы следует, что если часть поверхности диэлектрика затеняется, например, внутренним электродом, то интенсивность эрозии там существенно уменьшается (1 — начальная, 2 — конечная форма диэлектрика после серии разрядов; 3 — излучающая зона плазменного фокуса; диэлектрик — полиформальдегид; энергия разряда — 10 кДж; ток — до 0,3 МА). (Экспериментальные данные рис. 2 предоставлены А. С. Камруковым, П. А. Овчинниковым и И. И. Теленковым.)

Хорошо описывается также инерционность плазмообразования, связанная просто со временем пролета плазмы от зоны ускорения до излучающей зоны фокуса. Действительно, пролетное время  $t_0 = v_0 d_F$  ( $d_F$  — расстояние от диэлектрика до фокуса) при данных [6, 8] ( $v_0 = 5 \cdot 10^4$  м/с,  $d_F = 3-5$  см) примерно равно параметру инерционности  $t_* \approx 1$  мкс, полученному в [12] для тех же условий.

Таким образом, имеется вполне достаточное количество аргументов в пользу указанного предположения.

**2. Подобие течений плазмы в МПК-разрядах.** Проведем анализ с помощью методов теории размерности и подобия расчетной системы уравнений численной модели ПДР МПК [8]:

$$(2) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) = 0, \quad \rho \mathbf{v}/dt = -\operatorname{grad} p + [\mathbf{j}, \mathbf{B}], \\ \mathbf{j} = (1/\mu_0) \operatorname{rot} \mathbf{B}, \quad \rho \mathbf{e}/dt = -p \operatorname{div} \mathbf{v} - \mathbf{q}.$$

Здесь  $p$  — давление;  $\mathbf{j}$  — плотность тока;  $\mathbf{B}$  — индукция магнитного поля;  $t$  — время;  $\mu_0$  — магнитная постоянная;  $\mathbf{e}$  — внутренняя энергия;  $\mathbf{q}$  — радиационный член. Такой анализ показывает, что два квазистационарных режима подобны при равенстве значений критериев Маха  $M$ , Альфена  $\beta$ , эффективного показателя адиабаты  $\gamma$  и радиационного критерия  $\Omega t = (q_x t_x)/(\rho_x \epsilon_x)$ , а также при геометрическом подобии границ (индексом  $x$  отмечены характерные значения параметров). Под подобием понимается совпадение распределений безразмерных значений функций ( $\rho/\rho_x$ ,  $\epsilon/\epsilon_x$ ,  $v/v_x$  и др.) в пространстве безразмерных координат (т. е. отнесенных к характерному размеру  $L$ ). Подобие позволяет построить численную модель, описав конфигурацию различных зон разряда и основные рабочие процессы с помощью системы безразмерных коэффициентов  $C_i$  по одному режиму и используя затем постоянство значений  $C_i$  при переходе к другим подобным режимам, характеризующимся иными линейными масштабами  $L$  или мощностью энерговклада  $P$ .

Результаты численного моделирования эрозионных ПДР МПК в вакууме в достаточно подробной постановке [8] показывают, что такое подобие выполняется при значительных вариациях значений критериев  $M_0$  и  $\beta_0$ : при изменении  $M_0$  в 2, а  $\beta_0$  в 4 раза (при прочих равных) характерные

размеры зон, перепады величин в области фокуса и другие параметры, характеризующие конфигурацию течения и рабочие процессы, остались постоянными с точностью до 10–30 % [8]. Слабая зависимость течения от этих критериев связана с тем, что для рассматриваемых разрядов характерны  $\beta_0 \gg 1$  и  $M_0 \gg 1$  [6]. Значения  $\gamma$  для плазмообразующих веществ МПК при характерных температурах плазмы  $T_x = 2–7$  эВ меняются в пределах 5–15 % [21],  $\gamma$  практически не нарушает подобия. Для критерия  $\Omega_F t_F$ , определяющего световой КПД разряда, не следует ожидать сохранения значений, однако этот критерий влияет лишь на зону фокуса [8]: только  $\Omega_F t_F$  не малы по сравнению с единицей, а вверх по сверхзвуковому потоку газодинамическое возмущение не распространяется (индексом  $F$  здесь и далее обозначены параметры плазменного фокуса). Таким образом, если в указанной упрощенной модели учсть влияние  $\Omega_F t_F$  хотя бы в первом приближении, то можно надеяться на достаточную надежность описания основных тенденций.

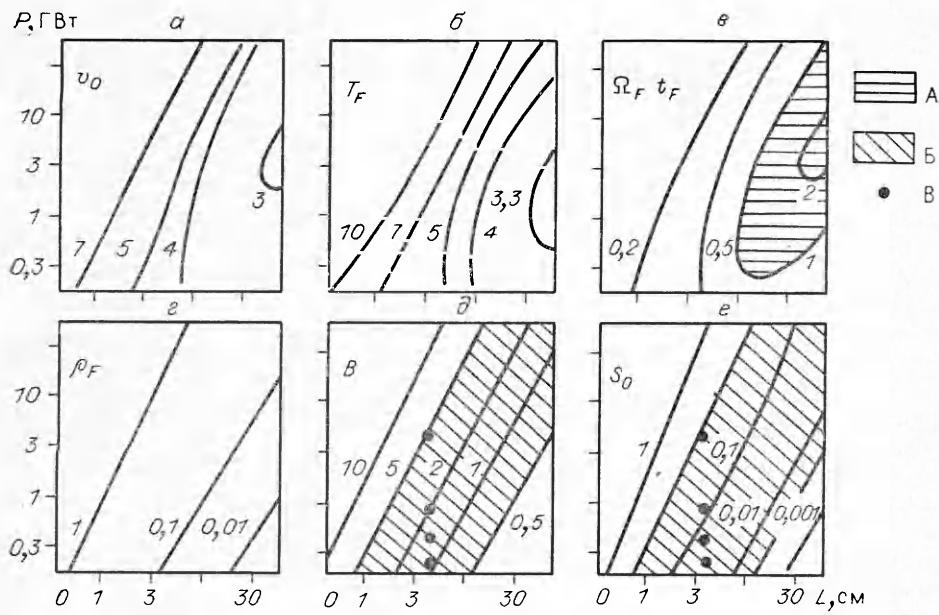
**3. Численная модель разряда.** Построим такую модель для режимов, подобных исследованному в [8]. Согласно [8], элемент массы плазмы, образовавшийся в точке с радиальной координатой  $r_0 = C_1 L$ , ускоряется до  $v_0$  и движется в течение  $t_0 = d_F/v_0$  почти инерционно ( $d_F = C_2 L$  – расстояние до фокуса); в зоне компрессии его скорость снижается до  $v_F = C_3 v_0$ . Давление там определяется срабатываемым скоростным напором,  $p_F = \rho_0 v_0^2 (1 - C_3)$  ( $\rho_0 = \rho_0 r_0 / r_F$ ,  $r_F = C_4 L$  – радиальный размер фокуса), а внутренняя энергия сразу после торможения – энталпийей  $h_F$ ,  $\varepsilon_F = h_F / \gamma_F = (1 - C_3^2) v_0^2 / (2\gamma_F)$ . Скоростной напор потока сразу за зоной ускорения равен магнитному давлению перед ней (вследствие сохранения импульса для этой зоны):  $\rho_0 v_0^2 = B^2 / (2\mu_0)$ ,  $B = \mu_0 I / (2\pi r_0)$ ,  $I$  – сила тока разряда. Связь между  $I$  и  $P$  задает сопротивление МПК как элемента цепи разряда,  $R = P/I^2$ , имеющее в основном активную составляющую, связанную с плазмодинамическим характером энерговклада и пропорциональную уровню скоростей плазмы [8, 12]:  $R = C_5 v_0 / \mu_0$ . Необходимый для замыкания модели с помощью (1) поток плазмообразующего излучения  $S_0$  в точке  $r_0$  в момент  $t$  вычисляется как  $S_0(t) = E_F(t) \cdot \eta_r / (4\pi d_F^2)$ , где  $E_F(t) = (1 - C_3^2) C_6 P(t - \Delta t) / r_F$  – кинетическая энергия потока, преобразующаяся в единицу времени во внутреннюю энергию фокуса;  $C_6$  – доля (по кинетической энергии) тех трубок потока, которые проходят через фокус;  $P(t - \Delta t)$  – электрическая мощность;  $\Delta t \simeq t_0$ . Эффективность  $\eta_r$  перехода внутренней энергии в излучение определялась на основе уравнения энергии из системы (2), которое с учетом примерного постоянства  $\Omega_F$ ,  $v_F$  и  $p_F$  на эффективной длине фокуса  $z_F = C_7 L$  [8] принимает вид  $d(\rho\varepsilon)/dt = -\Omega_F(\rho\varepsilon)$ , откуда  $\eta_r = \int q dt / (\rho_F \varepsilon_F) = 1 - \exp(-\Omega_F t_F)$ ,  $t_F = z_F/v_F$  (т. е. световой КПД  $\eta_l = (1 - C_3^2) C_6 \cdot (1 - \exp(-\Omega_F t_F)) / \gamma_F$ ). При вычислении  $q_F$  учитывается перепоглощение излучения как в самой зоне компрессии, так и в плазменном потоке. Результирующее выражение, правильно учитывающее вклад частотных диапазонов с большой ( $\tau_{nF} \gg 1$ ) и малой ( $\tau_{nF} \ll 1$ ) оптической плотностью фокуса, записывается как

$$q_F = \sum_n (1 - \exp(-\tau_{nF})) 2\pi J_{np}(T_F) \exp(-\tau_{n0}/r_F),$$

$$\tau_{nF} = 2r_F \kappa_n'(\rho_F, T_F), \quad \tau_{n0} = d_F \kappa_n'(\rho_0, T_0).$$

Здесь  $\sum_n$  – суммирование по группам квантов;  $\kappa_n'$  – групповые коэффициенты поглощения;  $J_{np}$  – интегралы функции Планка для интенсивности излучения;  $T$  – температура. Для фоторуглеродной плазмы функции  $p = p(\rho, T)$ ,  $\varepsilon = \varepsilon(\rho, T)$  задавались в соответствии с данными [21]; для геометрии электродов, подобной [6, 8],  $C_1 = 0,32$  (при  $L$ , равной радиусу внешнего электрода);  $C_2 = C_3 = 0,7$ ,  $C_4 = 0,05$ ,  $C_5 = 0,11$ ,  $C_6 = 0,6$ ,  $C_7 = 0,37$ .

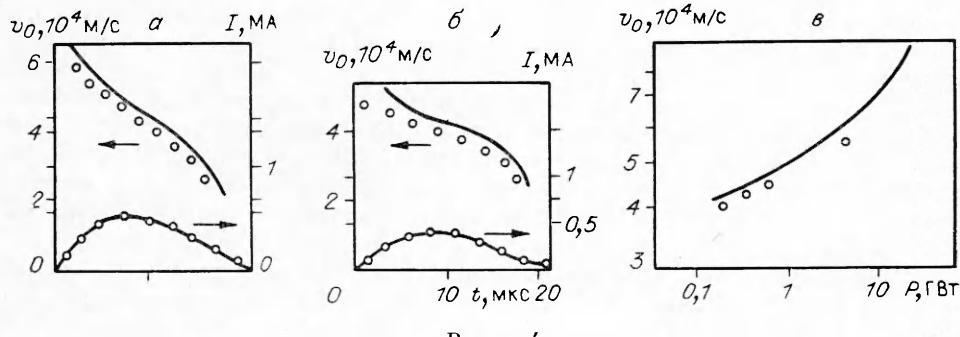
Приведенные соотношения вместе с (1) позволяют определить основные характеристики разряда и параметры плазмы по заданным значениям



Р и с. 3

масштаба  $L$  и мощности энерговклада  $P$  (последняя может вычисляться из уравнений Кирхгофа для цепи разряда) без каких-либо экспериментальных данных о режиме, т. е. эти соотношения представляют собой численную модель, единственный эмпирический параметр которой  $T_0 \simeq \simeq 1,6$  эВ, как показано ниже, постоянен в широком диапазоне параметров. Эта модель обоснована для режимов, для которых применим предложенный подход к описанию плазмообразования, а значения  $M_0$  и  $\beta_0$  отличаются от базовых меньше, чем в 2 и 4 раза.

**4. Анализ расчетов и сопоставление с экспериментом.** Результаты вычислений по описанной модели для квазистационарных разрядов представлены на рис. 3, 4. Диапазон режимов охватывает область энерговкладов и линейных масштабов, на порядок-два превышающих экспериментально исследованные. На рис. 3 приведены расчетные значения характерных параметров квазистационарных МПК-разрядов при различных  $P$  и  $L$  (электроды торцевой геометрии диаметром  $2L$  и  $L/2$ , плазмообразующий диэлектрик — фторопласт):  $a$  — скорость плазмы перед фокусом ( $10^4$  м/с);  $b$  — температура в фокусе (эВ);  $c$  — радиационный критерий;  $d$  — плотность плазмы в фокусе ( $\text{кг}/\text{м}^3$ );  $e$  — индукция магнитного поля у диэлектрика (3,5 Тл);  $f$  — световой поток из плазмы на границе с нарами диэлектрика ( $10^7$  Вт/см $^2$ ). А — область режимов с наибольшими  $\Omega_F t_F$ ; Б — режимы, при которых модель обоснована; В — режимы, исследованные экспериментально в [6, 18]. На рис. 4 проводится сопоставление расчетных (кривые) и экспериментальных [6, 18] (точки) данных для за-



Р и с. 4

вистимостей тока разряда и скорости плазменного потока от времени (*a* — для начального напряжения на емкостном накопителе 5 кВ, *b* — 3 кВ) и от мощности энерговклада в максимуме тока (*c*).

При большей части рассматриваемых режимов расчетные значения  $M_0$  лежат в пределах (0,65—1,2)  $M_{B0}$ , а  $\beta_0$  — (0,5—1,6)  $\beta_{B0}$ ;  $M_{B0}$ ,  $\beta_{B0}$  — значения  $M_0$ ,  $\beta_0$  в базовом режиме \*, т. е. приближенное подобие конфигурации течения в указанной на рис. 3 области должно соблюдаться. Для режимов, соответствующих исследованным в [6, 18], расчетные значения  $M_0$  меняются в пределах  $\pm 12\%$ , а  $\beta_0$  —  $\pm 25\%$  (подобие для них должно выполняться с хорошей точностью). Тогда сравнение результатов вычислений с экспериментальными данными может свидетельствовать о надежности описания процессов плазмообразования, поскольку описание остальных основных рабочих процессов достаточно хорошо обосновано. Такое сравнение проведено на рис. 4 для скорости плазменных потоков — надежно измеряемого параметра, непосредственно связанного с расходом плазмы. При  $0,1 < P < 4,3$  ГВт получено хорошее качественное и количественное согласие. В данном случае это отвечает примерному постоянству уровня скоростей с ростом  $P$  — пропорциональности расхода и мощности (такой результат нетривиален, так как излучательная способность плазмы фокуса растет быстрее линейного закона, компенсация происходит в основном за счет сужения полосы прозрачности плазменного потока, увеличения его оптической толщины — в результате повышения уровня плотности). Таким образом, предложенный подход к описанию плазмообразования правильно отражает зависимость расхода плазмы от мощности при  $L = 4$  см = const в пределах  $0,1 < P < 4,3$  ГВт.

Быстрый рост скоростей (или резкое уменьшение потоков массы, отнесенных к мощности энерговклада) вне указанного диапазона мощностей при данных масштабах (см. рис. 3) связан с уменьшением световых потоков, поступивших из фокуса: при малых  $P$  — за счет малой излучательной способности, при больших  $P$  — из-за непрозрачности плазменных потоков. В первом случае в экспериментах роста  $v_0$  не наблюдается, при плазмообразовании на первый план выходят другие процессы, и предложенный подход неприменим. При больших мощностях экспериментальные данные отсутствуют, и вопрос о применимости этого подхода остается открытым.

Согласно расчетам, вдоль линий  $PL^{-2} = \text{const}$  с точностью  $\approx 15\%$  сохраняются уровни магнитных полей и световых потоков на границу плазмы у диэлектрика (граничные условия для локально-одномерного плазмообразующего слоя). Отсюда выводим, что если описание этого слоя применимо к какому-либо режиму, то оно применимо и для целого семейства подобных режимов с  $PL^{-2} = \text{idem}$ . Предложенный подход к описанию плазмообразования, основанный на представлении о прогреве плазмы в радиационных волнах и постоянстве  $T_0$ , можно использовать в достаточно широком диапазоне режимов, включающем область энерговкладов, по мощности на порядок-два превышающих достигнутые экспериментально, причем для многих из этих режимов выполняются условия подобия течений, т. е. применимость модели там обоснована.

Отсюда следует, что в пределах указанного диапазона параметров в соответствии с расчетами уровень скоростей и температур меняется относительно слабо, плотность плазмы и давление монотонно растут с увеличением мощностей при  $L = \text{const}$  и слабо меняются вдоль кривых  $PL^{-2} = \text{const}$ . Скейлинг, обеспечивающий сохранение уровней таких локальных параметров плазменных потоков, как скорость, плотность, температура, индукция магнитного поля, плотность тока, давление, коэффициенты поглощения, поток излучения и другие, достигается при выполнении условия  $PL^{-2} = \text{const}$ , и экспериментальная отработка мощных

---

\* Базовый режим, по которому определялись значения  $M_{B0}$ ,  $\beta_{B0}$ , соответствует максимуму мощности энерговклада при наиболее подробно изученном разряде [6, 8]:  $P_B = 0,8$  ГВт,  $L_B = 4$  см.

разрядов может в значительной мере производиться на подобных по  $PL^{-2}$  режимах с умеренным энерговкладом. Значительный интерес представляет изучение неисследованных режимов с  $PL^{-2} \geq 10^{12}$  Вт/м<sup>2</sup>: эффективность разрядов рассмотренной торцевой геометрии в этих режимах может быть существенно выше расчетной — за счет увеличения тела свечения, прогрева плазменного потока токами и излучением и др. Отметим, что такие режимы можно достичь при умеренной мощности  $\approx 0,5 \cdot 10^9$  Вт для МПК размером  $2L < 1,5$  см.

Для одной и той же конструкции МПК значения радиационного критерия  $\Omega_F t_F$  (следовательно, и светового КПД) имеют максимум по мощности, положение его с увеличением масштабов МПК смещается в область больших энерговкладов. Среди режимов с  $PL^{-2} = idem$  эффективнее системы с большими размерами электродов, так как элемент массы, хотя и имеет ту же излучательную способность, дальше находится в зоне высокого давления и полнее высвечивает свою внутреннюю энергию. Существенно, что среди режимов с высокой электрической мощностью есть такие, световые КПД которых не только не уступают достигнутым экспериментально при умеренных энерговкладах [6], но и значительно их превосходят. Конкретные значения параметров относятся к конкретной форме электродов и фторуглеродной плазме, однако следует ожидать сохранения качественного вида зависимостей и при переходе к другим геометрическим соотношениям и рабочим веществам (в частности, термодинамические функции и зависимости оптических свойств в ВУФ для характерных плазмообразующих веществ МПК близки между собой [21, 22]).

Выражаем признательность Н. П. Козлову и А. С. Камрукову за обсуждение и ценные замечания.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Морозов А. И. Физические основы космических электроприводных двигателей.— М.: Атомиздат, 1978.— Т. 1.
- Камруков А. С., Козлов Н. П., Протасов Ю. С. Генераторы лазерного и мощного теплового излучения на основе сильноточных плазмодинамических разрядов // Плазменные ускорители и ионные инжекторы.— М.: Наука, 1984.
- Камруков А. С., Козлов Н. П., Протасов Ю. С. Плазмодинамические источники сплошного спектра // ДАН СССР.— 1978.— Т. 239, № 4.
- Алексеев Ю. А., Казеев М. Н. Численное моделирование двумерных течений в импульсных плазменных ускорителях // Физика плазмы.— 1981.— Т. 7, № 5.
- Гущин И. С., Попов Ю. П., Савицhev В. В. Расчет нестационарного ускорения плазмы с учетом аблации диэлектрика // Физика плазмы.— 1976.— Т. 2, № 5.
- Камруков А. С., Козлов Н. П., Протасов Ю. С. Динамика и излучение открытых (вакуумных) плазмодинамических разрядов типа «плазменный фокус» // ТВТ.— 1982.— Т. 20, № 2.
- Арцимович Л. А., Лукьянов С. Ю., Подгорный И. М., Чуватин С. А. Электромагнитное ускорение сгустков плазмы // ЖЭТФ.— 1957.— Т. 22, № 7.
- Арделян Н. В., Камруков А. С., Козлов Н. П. и др. Численное моделирование излучающих плазмодинамических разрядов магнитоплазменного компрессора эрозионного типа // ДАН СССР.— 1987.— Т. 292, № 3.
- Арделян Н. В., Камруков А. С., Козлов Н. П. и др. Магнитогазодинамические эффекты при взаимодействии с газом эрозионных плазменных потоков магнитоплазменного компрессора // ДАН СССР.— 1987.— Т. 292, № 1.
- Камруков А. С., Козлов Н. П., Протасов Ю. С., Чувашев С. Н. Радиационно-газодинамические процессы в кумулятивных плазмодинамических МПК-разрядах // ЖТФ.— 1985.— Т. 55, № 3.
- Камруков А. С., Козлов Н. П., Протасов Ю. С., Чувашев С. Н. О природе микронеоднородностей излучающих плазменных потоков // Письма в ЖТФ.— 1985.— Т. 11, № 23.
- Камруков А. С., Козлов Н. П., Протасов Ю. С., Чувашев С. Н. Расчет параметров плазменного потока импульсного эрозионного плазменного ускорителя // ПМТФ.— 1984.— № 2.
- Брущлинский К. В., Герлах Н. И., Морозов А. И. Влияние конечной проводимости на стационарные самосжижающиеся течения плазмы // ДАН СССР.— 1968.— Т. 180, № 6.
- Губарев В. Я., Козлов Н. П., Лесков Л. В., Протасов Ю. С. Определение теплового потока из плазмы на диэлектрик в импульсных эрозионных ускорителях // Плазменные ускорители.— М.: Машиностроение, 1973.
- Алексеев Ю. А., Казеев М. Н. Импульсное испарение изолятора в ускорителях плазмы с эрозией.— М., 1978.— (Препр./АН СССР, ИАЭ; № 3000).

16. Савичев В. В. К расчету скорости уноса массы диэлектрика в импульсном разряде // Вопросы физики низкотемпературной плазмы.— Минск: Наука и техника, 1970.
17. Лесков Л. В., Мухоян М. З., Савичев В. В. Исследование импульсного электромагнитного источника эрозионной плазмы // Там же.
18. Владимиров В. В., Дивнов И. И., Камруков А. С. и др. Магнитоплазменный компрессор с взрывомагнитным генератором энергии // ЖТФ.— 1980.— Т. 50, № 7.
19. Брушлинский К. В., Морозов А. И. Расчет двумерных течений плазмы в каналах // Вопросы теории плазмы.— М.: Атомиздат, 1974.— Вып. 8.
20. Ананин С. И., Лепшай Т. А. Численное моделирование динамики компрессионных плазменных потоков методом крупных частиц // ДАН БССР.— 1983.— Т. 27, № 8.
21. Камруков А. С., Козлов И. П., Протасов Ю. С., Чувашев С. Н. Оптические и термодинамические свойства фторуглеродной плазмы // ТВТ.— 1986.— Т. 24, № 1.
22. Камруков А. С., Козлов И. П., Протасов Ю. С., Чувашев С. Н. Оптические и термодинамические свойства плазмы полиформальдегида // ЖПС.— 1985.— Т. 43, № 6.

г. Москва

Поступила 22/VI 1988 г.,  
в окончательном варианте — 24/I 1989 г.

УДК 539.124

*B. I. Бойко, B. P. Кишкин, N. N. Прилепских, I. V. Шаманин*

## МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОГЛОТИТЕЛЕМ

Развитие ускорительной техники и специфика взаимодействия ионов с веществом расширили круг научных и практических задач, решение которых связывается с использованием мощных ионных пучков (МИП): исследования в области материаловедения и ядерной физики [1], работы по термоядерному синтезу [2, 3], проблемы генерации мощного электромагнитного излучения [4] и др. Во всех случаях физической основой является корректное описание динамики системы МИП — поглотитель.

Воздействие ионного пучка плотностью мощности  $>10^{12}$  Вт/м<sup>2</sup> на металлы сопровождается одновременным протеканием нескольких конкурирующих процессов перераспределения энергии [5]. Основные механизмы релаксации энергии МИП — гидродинамический, теплопроводящий и лучистый. Качественное поведение и количественные знания этих процессов определяются как параметрами МИП, так и характеристиками облучаемого вещества. Значительные энерговклады ионов в малые пространственные интервалы (10—20 мкм) за короткие промежутки времени (30—60 нс) усложняют приборное экспериментальное изучение динамики одного из каналов перераспределения энергии пучка одновременно в течение и после акта взаимодействия. В численных экспериментах все механизмы релаксации энергии учитываются селективно и их анализ не представляет особых сложностей. Качество результатов зависит от полноты описываемых процессов.

В настоящей работе предложена модель взаимодействия МИП — поглотитель, осуществлена математическая постановка задачи, разработаны алгоритм и программа решения, приведены результаты расчетов. В отличие от существующих методик (обзор в [6]) учитываются параметры пучка, влияющие на процесс взаимодействия: наличие ионов примеси, пространственная неоднородность, временная зависимость энергии и плотности тока. Термодинамические параметры вещества получаются из широкодиапазонного уравнения состояния. Модель основывается на двухмерном гидродинамическом приближении с включением механизмов электронной и лучистой теплопроводности. Приведены результаты расчета воздействия мощного протонно-углеродного пучка на алюминиевую фольгу. Двухкомпонентный состав ионов и пространственно-временная неоднородность плотности тока пучка определяют качественно отличающееся от существующих представлений поведение образовавшейся газоплазменной подсистемы.

**1. Модель и алгоритм расчета.** Процесс торможения ионов пучка в приповерхностной области поглотителя сопровождается энерговыделением и высокоскоростным нагревом. Поля возникающих давлений и температур характеризуются резкой неоднородностью и соответственно большими градиентами. Переход давления возбуждает ударную волну, распространяющуюся во внутреннюю область мишени, а на облучаемой поверхности формируется плазменное облако. Размеры области термализации пучка зависят как от энергии и типа ионов, так и от параметров